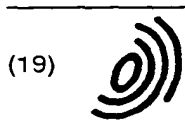


Kopie



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 964 281 A1

(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
15.12.1999 Patentblatt 1999/50

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: G02B 7/02, G03F 7/20

(21) Anmeldenummer: 99110271.6

(22) Anmeldetag: 27.05.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

• CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading as CARL ZEISS  
89518 Heidenheim (DE)  
Benannte Vertragsstaaten:  
GB IE

(30) Priorität: 09.06.1998 DE 19825716

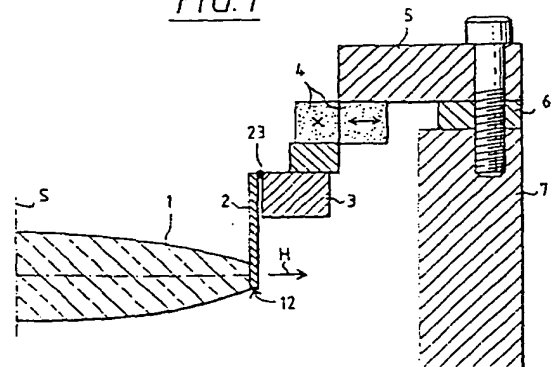
(71) Anmelder:  
• Carl Zeiss  
89518 Heidenheim (Brenz) (DE)  
Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR IT NL

(72) Erfinder:  
• Holderer, Hubert  
89551 Königsbrunn (DE)  
• Rümmer, Peter  
73447 Oberkochen (DE)  
• Trunz, Michael  
73479 Ellwangen (DE)

## (54) Baugruppe aus optischem Element und Fassung

(57) Baugruppe aus optischem Element (1) und Fassung (5), bei der das optische Element über eine Mehrzahl von Laschen (2) mit einem steifen Zwischenring (3) gekoppelt ist, der wiederum über Stellglieder (4) oder passive Entkoppler (35) mit einer Fassung (5) zum Anschluß an ein Gehäuse (7) und/oder an weitere Fassungen verbunden ist. Höchste mechanische Entlastung des optischen Elements, DUV-resistente Ausführungen. Anwendung in Projektionsbelichtungsanlagen.

FIG. 1



EP 0 964 281 A1

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Baugruppe aus optischem Element und Fassung, die Verwendung einer solchen Baugruppe, ein Objektiv damit und eine Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie damit. Optische Bauelemente, z.B. Linsen, Prismen, Spiegel, Gitter, vielfach aus Glas, Kristall oder Keramik bestehend, werden regelmäßig mittels Fassungen, in der Regel aus Metall, zu optischen Baugruppen, zum Beispiel Objektiven, zusammengebaut.

[0002] Dabei sind die optischen Elemente unter Einhaltung enger Toleranzen relativ zueinander zu positionieren und die ganze Baugruppe soll eine gewisse Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen aufweisen. Besondere Anforderungen werden dabei sowohl bei astronomischen Teleskopen, wie bei satellitengestützten Systemen (Beispiel ROSAT-Röntgenteleskop) und bei Projektionsbelichtungssystemen der Mikrolithographie gestellt.

[0003] EP 0 053 463 lehrt die Aufhängung von Präzisionsspiegeln an Blattfederelementen, die angeklebt werden.

[0004] Eine hochentwickelte Fassungstechnik für Linsen von Mikrolithographie-Projektionsobjektiven ist auch in US 5,428,482 beschrieben.

[0005] Entweder wird die Linse direkt mit drei radialen Biegebalken verklebt, oder ein Zwischenring ist über drei am Umfang gleichverteilte Festkörpergelenke mit einem äußeren Fassungsring verbunden. Vollflächige Verklebung von Linse und Zwischenring ist vorgesehen. Durch Stapeln der Fassungsringe wird dann die optische Baugruppe, insbesondere ein Objektiv, aufgebaut.

[0006] Anordnungen mit Aktuatoren zur Verlagerung oder Deformation optischer Elemente relativ zum Fassungs-Basisteil sind in vielfältiger Ausführung bekannt. Ein Beispiel gibt EP 0 145 902 A, wo ein Spiegel über drei tangentiale Speichen an einer Fassung aufgehängt ist, die durch Peltierelemente in ihrer Länge verändert werden können.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Baugruppe aus optischem Element und Fassung, bei der die Genauigkeit der Positionierung des optischen Elements und seine Entkopplung von auf die Fassung wirkenden Umwelteinflüssen gesteigert sind. Die Fügestelle zwischen optischem Element und Fassung, also in der Regel eine Glas-Metall- oder Kristall-Metall-Verbindung, soll gleichzeitig von Anforderungen an die geometrische Präzision entlastet werden, um sie für andere Fügeverfahren als Kleben hauptsächlich wegen der DUV-Beständigkeit zugänglich zu machen.

[0008] Die erfinderische Lösung soll als Konstruktionsprinzip eine große Bandbreite von Anwendungsfällen abdecken. Die Integration in ein Objektiv und die Verwendung in einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage ist vorgesehen, mit besonderer Eignung zur sehr feinfühligsten Regelung von dessen Abbildungsleistung.

[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Baugruppe aus optischem Element und Fassung nach Anspruch 1, bei der das optische Element über eine Mehrzahl von Laschen mit einem steifen Zwischenring gekoppelt ist, der wiederum über aktive Stellglieder oder passive Entkoppler mit einer Fassung zum Anschluß an ein Gehäuse und/oder an weitere Fassungen verbunden ist.

[0010] Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche 2 bis 26. Gemäß Anspruch 2 sind die Laschen als Federgelenke bzw. Blattfedern angelegt. Damit wird im wesentlichen die unterschiedliche Wärmeausdehnung vom optischen Element (z.B. Glas) und Fassung (Metall) aufgenommen. Insgesamt werden Spannungen minimiert.

[0011] Die Verbindung des optischen Elements mit den Laschen ist Gegenstand der Ansprüche 3 bis 7. Hier geht es darum, Stabilität gegen die Strahlung mit der das optische Element beaufschlagt wird zu sichern - was bei Klebungen im UV-Bereich ein Problem ist - und gleichzeitig keine Spannungen im optischen Element aufzubauen, wie das bei formschlüssigen Verbindungen (Klemmung) unvermeidbar ist. Metallische Schweiß- oder Lötverbindungen werden daher bevorzugt.

[0012] Gemäß den Ansprüchen 8 bis 12 gilt ähnliches für die Verbindung der Laschen mit dem Zwischenring, wobei hier auch die homogene einstückige Ausführung nach Anspruch 8 möglich und in vielen Fällen sinnvoll ist. Wo jedoch Lagetoleranzen der Laschen an der Verbindung zum optischen Element auszugleichen sind, ist die Fügung an den Zwischenring z.B. durch Laserschweißen nach Anspruch 12 vorteilhaft.

[0013] Gemäß Anspruch 13 sind Piezoelemente, aber auch Peltierelemente (nach EP 0 145 902 A) geeignete Antriebsmittel für die aktiven Stellglieder, die zudem geeignete Getriebe (Festkörperhebel und -gelenke) umfassen können.

[0014] Gemäß Anspruch 14 sind für die passiven Entkoppler in erster Linie Festkörpergelenke und -getriebe geeignet, etwa entsprechend US 5,428,482.

[0015] Eine bedeutende Klasse von optischen Elementen sind die nach Anspruch 15 vorgesehenen mit rotationssymmetrischem Rand mit einer Symmetrieachse. Dies umfaßt insbesondere die klassischen Linsen mit zylindrischem Rand, durchaus auch mit nicht sphärischen und nicht zentrierten optischen Flächen.

[0016] Dafür geben die Ansprüche 16 bis 18 vorteilhafte Ausführungen des Zwischenrings und der Laschen an.

[0017] Anspruch 19 gibt eine weitere Klasse von optischen Elementen an, die in Anspruch 15 beschriebene ist darin enthalten - mit denen besonders vorteilhafte Ausführungen u.a. nach den Ansprüchen 20 und 21 hinsichtlich der Laschenanordnung möglich sind. Die Laschen sind danach wie Speichen zwischen dem optischen Element "Nabe" und dem Zwischenring "Felge" angeordnet.

[0018] Nach Anspruch 22 sind die Laschen ähnlich wie die Balken der US 5,428,482 tangential angeordnet.

[0019] Anspruch 23 beschreibt einen wesentlichen Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung, die mit ihren vielen freien Konstruktionsparametern gut die Einstellung einer niedrigsten Eigenfrequenz mechanischer Schwingungen größer als 200 bis 400 Hz ermöglicht. Damit werden die im wesentlichen bei niedrigeren Frequenzen vorliegenden störenden Schwingungsanregungen wirksam unterdrückt.

[0020] Ansprüche 24 und 25 dokumentieren die mit der Erfindung erreichbare hohe Güte der spannungsfreien Lagerung. Es werden astigmatische bzw. 3 wellige Rest-Linsendeformationen unter 30 nm, bis unter 20 nm, erreicht. Die Deformationen der Auflagefläche des Außenrings werden zu über 95 %, vorzugsweise über 98 % und in optimalen Konstruktionen zu über 99 % von der Linse entkoppelt.

[0021] Passive Stellglieder, wie sie nach Anspruch 26 vorgesehen sind, eignen sich besonders zur Justage nach den Ansprüchen 30 oder 31.

[0022] In ihrem bevorzugten Einsatz sind die Baugruppen gemäß den Ansprüchen 27 bis 29 in Objektiven und Projektionsbelichtungsanlagen der Mikrolithographie, wobei besonders die Einbindung in Regelkreise nach Anspruch 28 die Korrektur extrem feiner Störungen ermöglicht.

[0023] Näher erläutert wird die Erfindung anhand der Zeichnungen.

Figur 1 zeigt einen schematischen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Anordnung mit hängenden Laschen und Aktuator;

Figur 2 zeigt einen schematischen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Anordnung mit liegenden Laschen und Festkörpergelenk zwischen Zwischenring und Fassung;

Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf eine Anordnung nach Art der Figur 2;

Figur 4 zeigt eine Aufsicht auf eine erfindungsgemäße Anordnung mit tangentialen Laschen;

Figur 5 zeigt einen schematischen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Anordnung mit Spiegel und Aktuator mit Hebelgetriebe;

Figur 6 zeigt schematisch eine Projektionsbelichtungsanlage;

Figur 7 schematisch eine bevorzugte Federlasche.

[0024] Die in Figur 1 dargestellte Anordnung weist eine Linse 1 und eine Fassung 5 auf. Erfindungsgemäß ist ein steifer Zwischenring 3 - z.B. ein Edelstahlring von (größenordnungsmäßig) 1 cm<sup>2</sup> Querschnitt abhängig

von Masse und Steifigkeit der Linse - vorgesehen, der über Laschen 2 mit der Linse 1 und über Aktuatoren 4 mit der Fassung 5 verbunden ist. Über eine Zwischenlage 6, die der exakten Höhenjustage dient, ist die Fassung an ein Gehäuse 7 angeschlossen, das z.B. als Abstandsring zu einer weiteren derart geformten Linse ausgebildet ist.

[0025] Die Verbindung 12 der Linse 1 mit den Laschen 2 ist aus zwei Gründen problematisch:

[0026] Erstens ist die Werkstoffpaarung durch die unterschiedlichen Eigenschaften des optischen Elements 1 aus Glas, aus Kristallen wie CaF<sub>2</sub> oder Quarz oder aus Glaskeramik (Zerodur(R)-Spiegel) und der Metall-Laschen 2 aus Edelstahl, Federbronze oder dergleichen beim Schweißen, Löten aber auch beim Schrauben oder Nieten problembehaftet.

[0027] Zweitens ist diese Fugestelle durch die Strahlung, zu deren Transport das optische Element da ist, belastet - mit Ausnahmen bei Spiegeln -. Bei Anwendungen im tiefen UV-Spektralbereich (etwa 300 - 100 nm Wellenlänge) führt dies zur weitgehenden Unbrauchbarkeit organischer Kleber, da diese durch die Strahlung zerstört werden.

[0028] Daneben ist diese Verbindung 12 mit sehr engen geometrischen Toleranzen auszuführen, um den Zweck der Anordnung zu erreichen.

[0029] Weiter sind die optischen Elemente 1 empfindlich gegen thermische Belastungen, da beispielsweise Antireflexbeschichtungen Temperaturen deutlich über 100° C nicht vertragen und andererseits Gläser und besonders Kristalle wie CaF<sub>2</sub> - das wegen seiner DUV-Transparenz als Partner zu Quarzglas für achromatisierte Optiken benötigt wird - empfindlich gegen zeitliche und räumliche Temperaturgradienten sind.

[0030] Im Beispiel ist die Verbindung 12 durch eine Ultraschallschweißung, wie sie beispielsweise aus E. Röder et al., Technologie & Management 44 (1995), Seite 31-39 bekannt ist, hergestellt, womit die o.g. Probleme beherrscht werden können. Eine andere mögliche Fügetechnik ist das Löten mit niedrigschmelzenden Loten wie in DE 197 55 356 dargestellt. Positionstoleranzen der Laschen 2 können durch die Kopplung 25 der Laschen an den steifen Zwischenring aufgefangen werden, wenn diese anschließend ausgeführt wird. Dafür hat sich das Laserschweißen als geeignet gezeigt, wodurch bei geringem Wärmeeintrag sehr gleichmäßige Schweißverbindungen erzielt werden.

[0031] Die Laschen 2 sind als Blattfederelemente aus Elch durch Stanzen oder Ätzen präzise geformt. Sie sind typisch 0,1 mm bis 0,5 mm dick, ca 3-20 mm breit und 10-30 mm lang, bei einem Abstand von einigen mm. Im Beispiel sind sie parallel zur optischen Achse und Symmetrieachse der Linse 1 angeordnet.

[0032] Eine Ausführung nach Figur 7, ein Ätz- oder Stanzteile mit steifem Bügel 71, zwei tangentialen Blattfederelementen 72, 73 und Zone 74 zum Ultraschallverschweißen mit der Linse dazwischen ergibt momentenfreie radiale Ausdehnungsmöglichkeit der

[0040] Figur 4 zeigt in gleicher Aufsicht eine erfindungsgemäße Anordnung mit tangential an die Linse 1 angreifenden Laschen 24, die hier auch senkrecht zur Zeichenebene stehen und damit im Sinne von

[0046] Abhängig von Bildparametern (Sensor 671) wie Fokusslage, Wellenfront und dergleichen, von Beleuchtungsparametern (Sensor 672) wie Pulsdauer, Zahl, Beleuchtungseinstellung wie Kohärenzgrad, Quadrupolbeleuchtung, und/oder von Parametern der Maske (Sensor 673) regelt das Leitsystem 67 durch ansteuern der Aktuatoren 653 wie auch ggf. der Aktuatoren anderer optischer Elemente die optimale Bildqualität, wobei in der Regel im Leitsystem 67 abgelegte Kennfelder und Kalibrierparameter Verwendung finden.

1. Baugruppe aus optischem Element (1) und Fassung (5), bei der das optische Element über eine Mehrzahl von Laschen (2) mit einem steifen Zwischenglied (3) gekoppelt ist, der wiederum über Stellglieder (4) oder passive Entkoppler (35) mit

- einer Fassung (5) zum Anschluß an ein Gehäuse (7) und/oder an weitere Fassungen verbunden ist.
2. Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (22) als Federgelenke, insbesondere als Blattfedern, ausgelegt sind. 5
  3. Baugruppe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (2) stoffschlüssig mit dem optischen Element (1) verbunden sind. 10
  4. Baugruppe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Laschen (2) mit dem optischen Element (1) gegen ultraviolette Strahlung, insbesondere bei Wellenlängen unter 300 nm, resistent ist. 15
  5. Baugruppe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Element (1) aus Glas oder Kristall besteht, die Laschen (2) aus Metall und die Verbindung frei von organischen Bestandteilen ist. 20
  6. Baugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung geschweißt ist, insbesondere durch Diffusionsschweißung oder Ultraschallschweißung. 25
  7. Baugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung gelötet ist. 30
  8. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (22) mit dem Zwischenring (32) einen einteiligen Körper bilden. 35
  9. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (2) stoffschlüssig an den Zwischenring (3) gekoppelt sind. 40
  10. Baugruppe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Kopplung der Laschen (2) mit dem Zwischenring (3) gegen ultraviolette Strahlung, insbesondere bei Wellenlängen unter 300 nm, resistent ist. 45
  11. Baugruppe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Kopplung frei von organischen Bestandteilen ist. 50
  12. Baugruppe nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Kopplung geschweißt ist, insbesondere durch Laserschweißen. 55
  13. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Stellglieder (4) Piezoelemente oder Peltierelemente 5
- enthalten.
14. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die passiven Entkoppler (35, 35') Festkörpergelenke enthalten.
  15. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Element (1) einen rotationssymmetrischen Rand mit einer Symmetrieachse (S) aufweist.
  16. Baugruppe nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwischenring (2) zur Symmetrieachse (S) rotationssymmetrisch ist.
  17. Baugruppe nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (2) symmetrisch zu die Symmetrieachse enthaltenden Ebenen (E) ausgebildet sind.
  18. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (22) gleichmäßig über den Umfang des optischen Elements (1) verteilt angeordnet sind.
  19. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Element (1) eine Haupt-Ebene (H) aufweist, welche sein Rand mit einer geschlossenen Kurve durchstößt.
  20. Baugruppe nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (22) im wesentlichen senkrecht zur Haupt-Ebene (H) angeordnet sind.
  21. Baugruppe nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (22) im wesentlichen in der Haupt-Ebene (H) radial zum Rand des optischen Elements (1) angeordnet sind.
  22. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Laschen (22) im wesentlichen tangential zum Rand (1R) des optischen Elements (1) angeordnet sind.
  23. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß die niedrigste Eigenfrequenz mechanischer Schwingungen größer als 200 Hz, vorzugsweise größer als 300 Hz, bis zu etwa 1 KHz ist.
  24. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die astigmatische und die dreiwellige Deformation des optischen Elements (1) unter 30 nm liegt.
  25. Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche

1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Deformationen der Auflagefläche des Außenrings (5) zu über 95 % vom optischen Element (1) entkoppelt sind.

57

26. Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Teil der Stellglieder (4) passiv ist.
27. Objektiv (65) enthaltend zumindest eine Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 26. 10
28. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie enthaltend zumindest eine Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 26, mit mindestens einem Aktuator (653), dadurch gekennzeichnet, daß ein Regelkreis vorhanden ist, der mindestens einen Aktuator (653) ansteuert. 15
29. Verwendung einer Baugruppe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 26 zum Aufbau einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage. 20
30. Verwendung des passiven Stellgliedes nach Anspruch 26 zur Justage der Linse zu einer Referenz außerhalb des Objektives nach Anspruch 27. 25
31. Verwendung des passiven Stellgliedes nach Anspruch 26 zur Justage der Linse innerhalb des Objektives nach Anspruch 27 während der Justage derselben. 30

35

40

45

50

55

FIG. 1

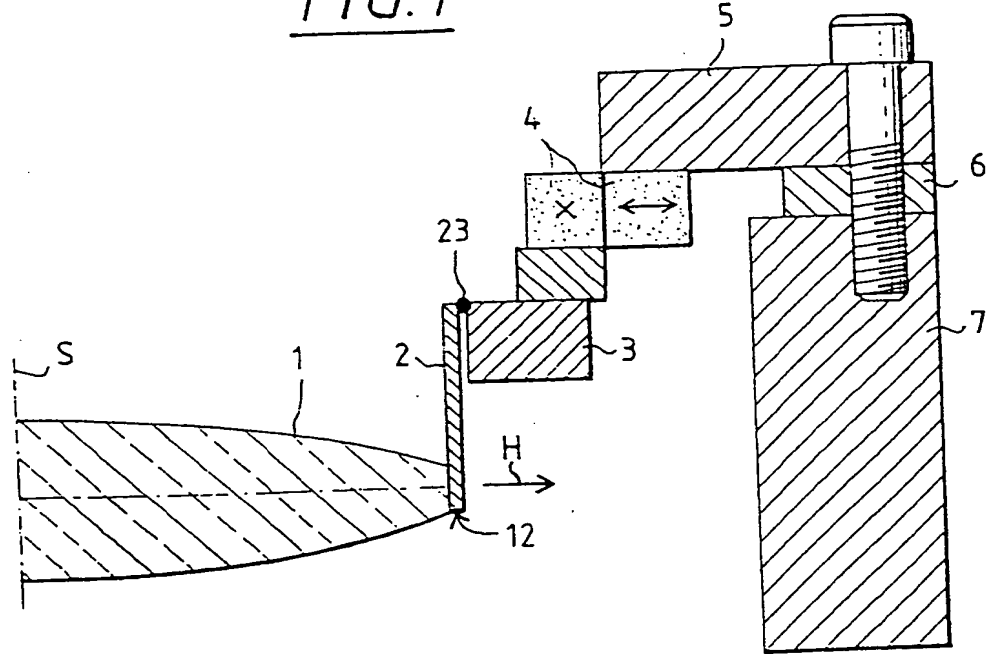


FIG. 2

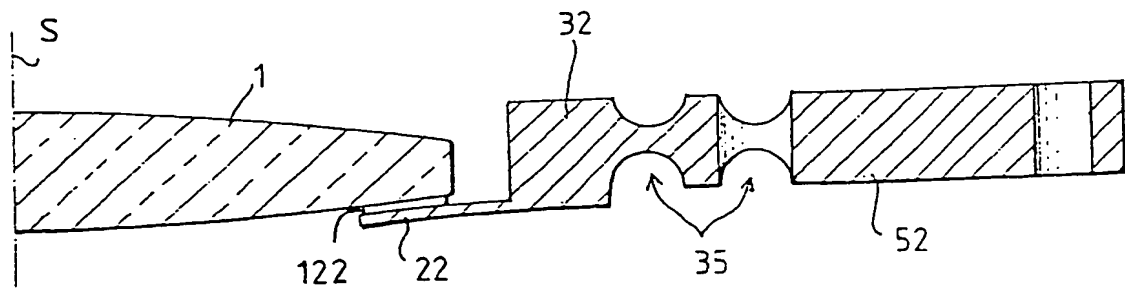


FIG. 4

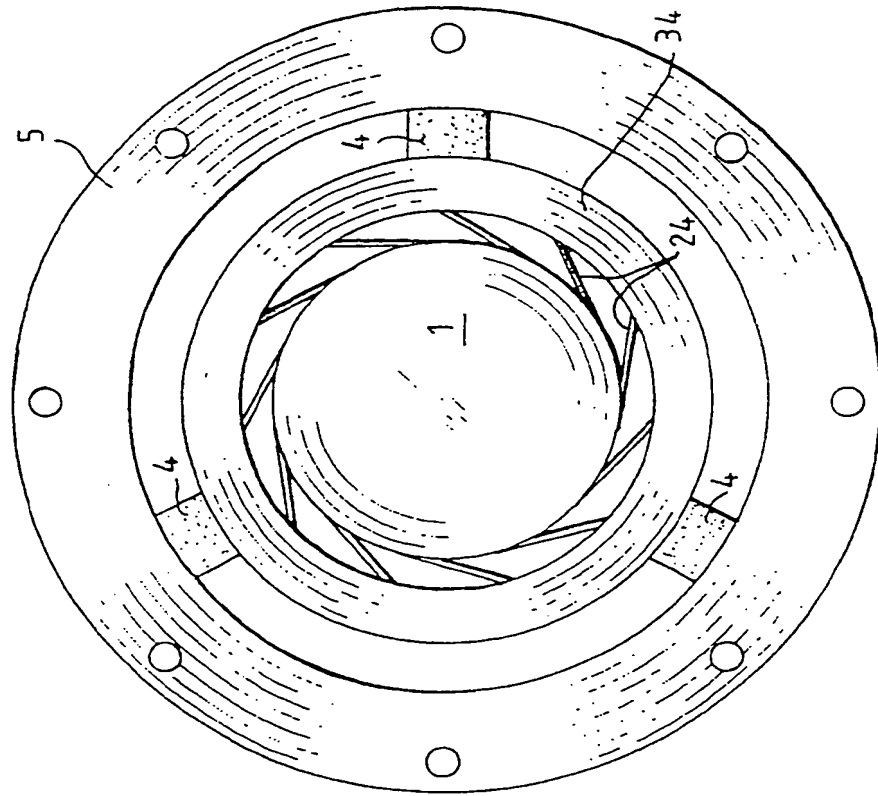


FIG. 3

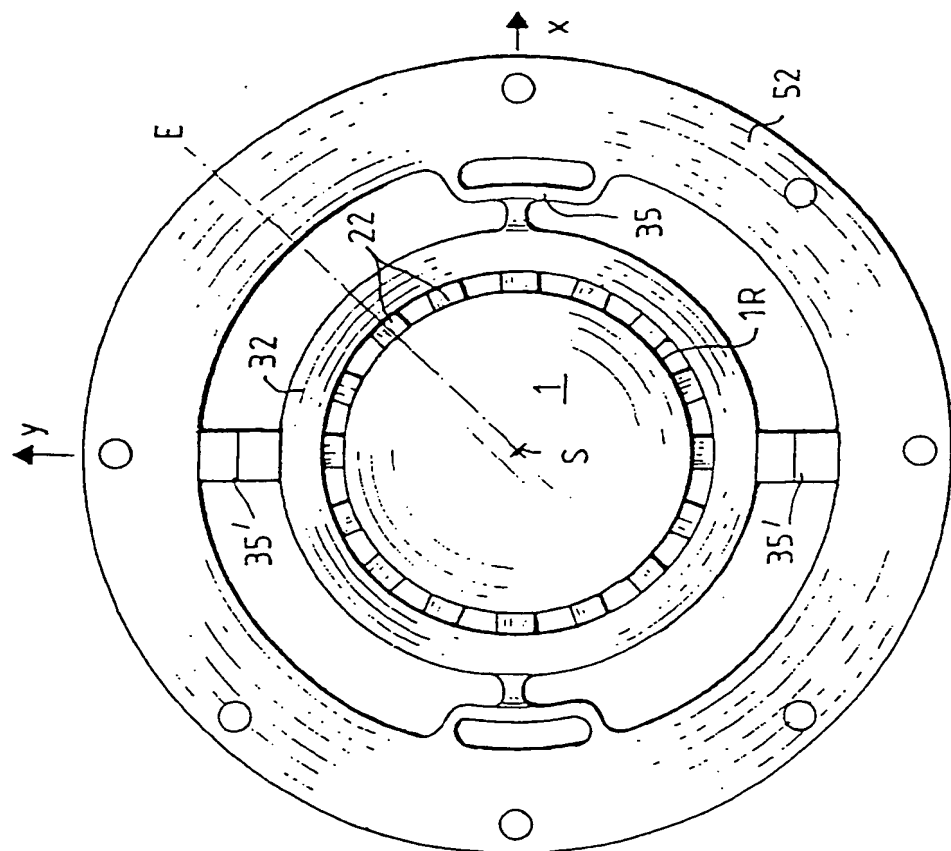




FIG. 5

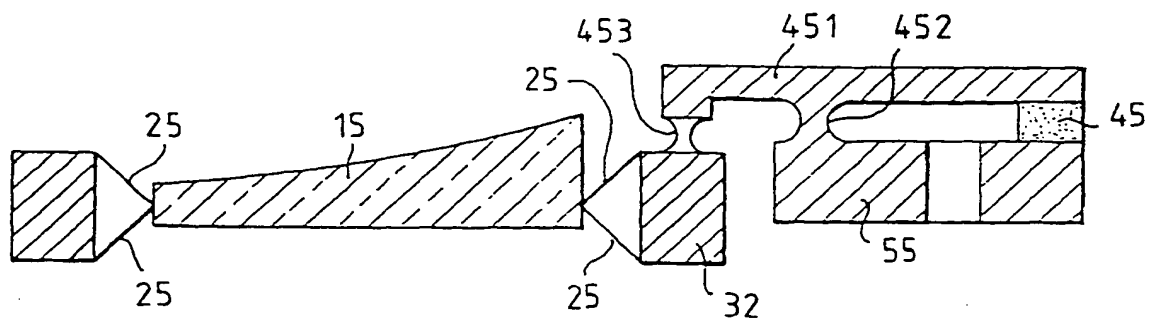


FIG. 6

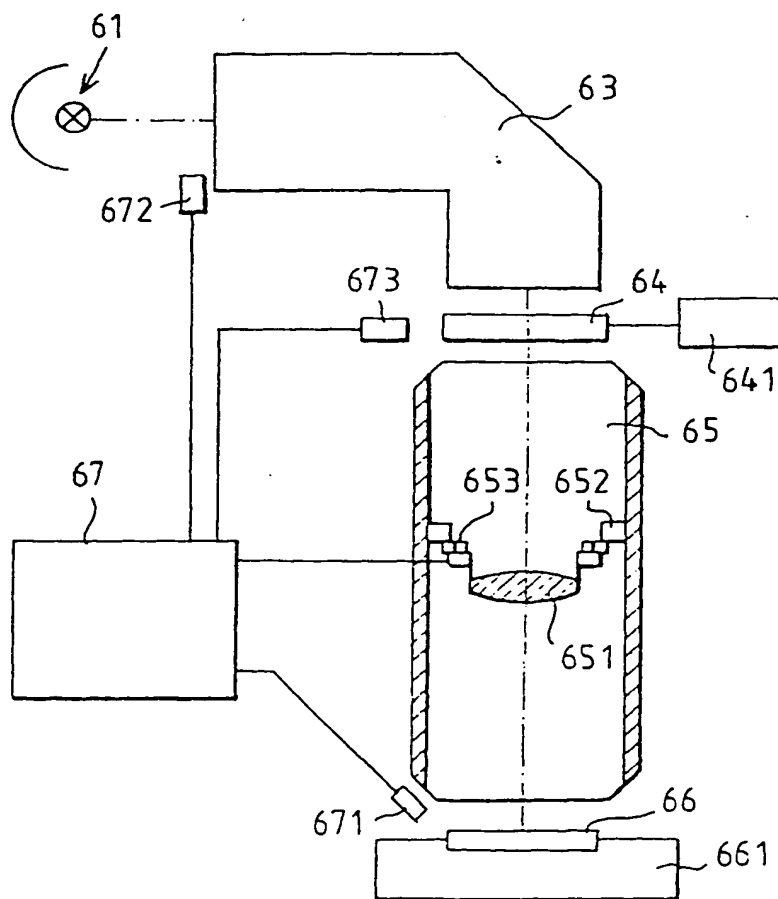
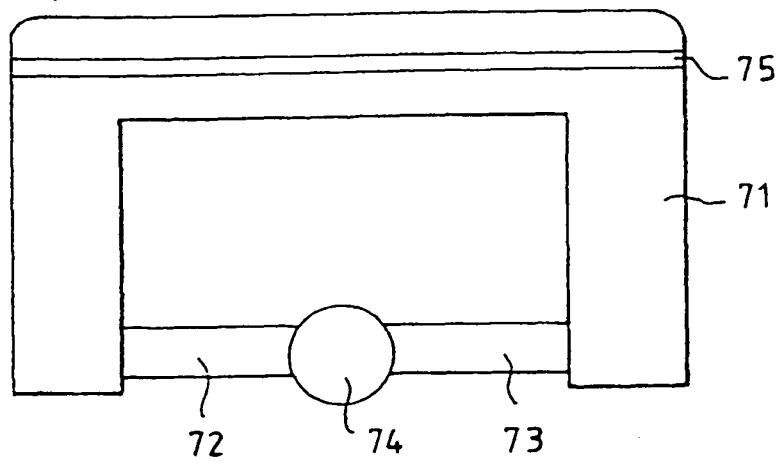


FIG. 7





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 99 11 0271

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	DE 37 14 745 A (JENOPTIK JENA GMBH) 18. Februar 1988 (1988-02-18) * Spalte 4, Zeile 53 - Zeile 65; Abbildung 1 *	1	G02B7/02 G03F7/20
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 097 (P-446), 15. April 1986 (1986-04-15) & JP 60 230609 A (KONISHIROKU SHASHIN KOGYO KK), 16. November 1985 (1985-11-16) * Zusammenfassung *	1,8, 15-21	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 199, no. 805, 30. April 1998 (1998-04-30) & JP 10 026736 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 27. Januar 1998 (1998-01-27) * Zusammenfassung *	1	
X	US 5 523 893 A (HAAS EDWIN G) 4. Juni 1996 (1996-06-04) * Spalte 3, Zeile 20 - Zeile 35; Abbildungen 1,5 * * Spalte 5, Zeile 11 - Zeile 43; Abbildung 6 * * Spalte 6, Zeile 40 - Zeile 50; Abbildungen 9,10 *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) G02B G03F
X	DE 31 16 579 A (JENOPTIK JENA GMBH) 24. Juni 1982 (1982-06-24) * Seite 5 - Seite 6; Abbildung 2 *	1	
D,A	US 5 428 482 A (BRUNING JOHN H ET AL) 27. Juni 1995 (1995-06-27) * Zusammenfassung * * Spalte 5, Zeile 17 - Zeile 32; Abbildungen 7,8,11 *	1,27-29	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 20. Oktober 1999	Prüfer Ciarrocca, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument C: aus anderen Gründen angeführtes Dokument A: technologischer Hintergrund O: nichtschrittliche Offenbarung P: Zwischenliteratur	
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschrittliche Offenbarung P: Zwischenliteratur		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument C: aus anderen Gründen angeführtes Dokument A: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1501 03.92 (P04C03)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 99 11 0271

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
D, A	EP 0 053 463 A (FUJITSU LTD) 9. Juni 1982 - (1982-06-09) * Zusammenfassung * * Seite 6, Zeile 8 - Zeile 18; Abbildung 3 * -----	1, 2	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort: <b>BERLIN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>20. Oktober 1999</b>	
		Prüfer <b>Ciarrocca, M</b>	
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPU FORM 1501 03 82 (P4C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 11 0271

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obgenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

20-10-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 3714745	A	18-02-1983	DD	250784 A	21-10-1987
JP 60230609	A	16-11-1985	KEINE		
JP 10026736	A	27-01-1998	KEINE		
US 5523893	A	04-06-1996	KEINE		
DE 3116579	A	24-06-1982	DD	151230 A	08-10-1981
US 5428482	A	27-06-1995	US	5488514 A	30-01-1996
			US	5353166 A	04-10-1994
EP 0053463	A	09-06-1982	JP	1375640 C	22-04-1987
			JP	57090607 A	05-06-1982
			JP	61040085 B	08-09-1986
			IE	52953 B	27-04-1988
			US	4420223 A	13-12-1983

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang, siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82